⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 113328

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)5月18日

G 01 L 5/16

7409-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

の発明の名称 荷重検出器

②特 顧 昭61-258520

❷出 願 昭61(1986)10月31日

@発明者 緒方 浩二郎 茯

茨城県土浦市神立町650番地 日立建機株式会社土浦工場

内

69発明者 小野 耕三

茨城県土浦市神立町650番地 日立建機株式会社土浦工場

内

@発明者 高田 龍二

茨城県土浦市神立町650番地

日立建機株式会社土浦工場

内

6発明者 草木 貴巳

茨城県土浦市神立町650番地 日立建設株式会社土浦工場

内

⑪出 願 人 日立建機株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

仍代 理 人 弁理士 武 顯次郎

外1名

明知音

1. 発明の名称

荷重検出器

2. 特許請求の範囲

リング形状の第1の荷重伝達部と、この第1の 荷重伝達部と対向する第2の荷重伝達部と、この 第2の荷重伝達部に一端が連結されかつ所定個所 に検出素子が設けられた直交する2つの平行平板 構造を有する角柱形状の第1の荷重検出部と、こ の第1の荷重検出部の他端に連結された円柱と、 この円柱と前記第1の荷重伝達部とに連結されか つ所定個所に検出素子が設けられた薄板より成る 第2の荷重検出部とを備えていることを特徴とす る荷重検出器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、種々の物体に加わる荷度を、直交する軸方向の力とそれらの軸まわりのモーメントと に分離して検出する荷度検出器に関する。

(従来の技術)

物体に加わる荷重(力・モーメント)を検出することは多くの分野において不可欠のことである。例えば、高機能ロボツトにより組立作業や研察、バリ取り作業を行う場合、当該ロボツトのハンドに作用する力を正確に検出することが必要であるし、又、航空機、船舶、車両等のモデル試験を実施する場合も、各部にかかる荷重の検出が主要な項目となる。このような荷重を検出する荷重検出器として優れた性能を有するものが、特別昭60-62497 号公報により提案されている。以下、図によりその概略構成を説明する。

第11図は従来の荷重検出器の斜視図である。図で、1は柱状体、ia、1b、ic、1d は柱状体1においてX触方向およびY触方向に張出した 張出し郎、2は柱状体1の中心において Z軸方向に形成された貫通孔である。3a、3b、3c。3d はそれぞれ各張出し部1a、1b、1c、1d において Z軸方向の方形貫通孔により構成される 平行平板構造である。又、4a、4b、4c、4d はそれぞれ各張出し部1a、1b、1c、1d の

特開昭63-113328 (2)

上記荷重検出器において、荷重伝途部 6 . 7 間に 2 髄方向の力 F_z . X 髄まわりのモーメント M_x . Y 髄まわりのモーメント M_y . が作用すると、これらは平行平板構造 4a . 4b . 4c . 4d により検出され、又、X 勧方向の力 F_x . Y 勧方向の力

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するため、本発明は、リング形状の第1の荷重伝達部およびこれと対向するに達がある。 この荷重伝達部を配数し、第2の荷重伝達の第1の荷重検出部の一種を連結する。 ことを第1の荷重との質量にはなり第2の荷重を設けるとのでは、第2の荷重を構成し、それら平板では、第2の荷重を設けるとともに、第2の荷重は、それら平板では、第2の荷重は、それら平板では、第2の荷重を構成し、それら平板で、第2の荷重は、それら平板で、第2の荷重を設けるとといい。

(作用)

第1の荷重伝達部および第2の荷重伝達部間に Z 独方向の力F z 、 X 執まわりのモーメントM x が作用すると、これ ら荷重は第2の荷重検出部を構成する薄板の変形を検出素子で検出することにより検出され、又、 X 軸方向の力F x 、 Y 独方向の力P y 、 Z 執まわ

Fr. Z軸まわりのモーメントM:が作用すると、これらは平行平板構造 Sa. 3b. 3c. 3d により検出される。即ち、この荷量検出器は 3 軸方向の力成分および 3 軸まわりのモーメント成分を検出することができる。

(発明が解決しようとする問題点)

上記従来の荷重検出器は既に実用化され、その 使れた性能が認められている。しかしながら、そ の製造時、平行平板構造3a~3d,4a~4d を構成するため8つの穴明け加工を実施しなけれ ばならず、加工が箇倒であるという問題があつた。

さらに、各ストレンゲージSを貼着する場合、 その貼着面の数は、平行平板構造3a~3dで計 8面、平行平板構造4a~4dで計2面(図で上 下面)、合計10面となり貼着作業が面倒であると いう問題もあつた。

本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決 し、加工およびストレンゲージのような検出素子 の設置作業が容易であり、構造簡単な荷重検出器 を提供するにある。

りのモーメントMzが作用すると、これら荷重は第1の荷重検出部に構成された平行平板構造の変形を検出素子で検出することにより検出される。 (実施例)

以下、本発明を図示の実施例に基づいて説明する。

第1図は本発明の実施例に係る荷重検出器の正面図、第2図は同じく平面図、第3図は第2図に示す線I-Iに沿う断面図である。各図で、10は荷重が作用する荷重伝達部、11は荷重検出部である。柱状荷重検出部である。柱状荷重検出部であり、この柱体に、X独力におより、平行平板構造12、13が構成される。平行平板構造12の薄肉部の境界近傍における図示でで、1つの両側の長い等距離位置に1つずつ)にはストレンゲージの行号を示す。同じく、S...、S...

特開昭63-113328 (3)

Szi. Szzは平行平板構造13において中央の 2 軸に沿う線上に贴着されたストレンゲージを示す。 15は荷重伝達部10と対向して設けられたリング形状の価方の荷重伝達部である。

16は第2図に示すように柱状荷譲検出部11の端部(図では上端部)に連結された円柱である。17はリング形状の荷重伝連部15との間に連絡17の裏面(第2図において取面、第1.3図において下面)には、リング中心を通つてX動に沿う線上において、ストレンゲージSai.Sciは対したがある。ストレンゲージSai.Sciは対応重伝達部15との境界上に位置がよいないる。ストレンゲージSai.Sciは対応では、ストレンゲージSai.Sciは対応では、ストレンゲージSai.Sciは対応では、ストレンゲージSai.Sciは対応では、ストレンゲージSai.Sciは対応では、ストレンゲージSai.Sciは対応で、ストレンゲージSai.Sciに対応で、ストレンゲージSai.Sciに対応で、ストレンゲージSai.Sciに対応で、ストレンゲージSai.Sciに対応で、ストレンゲージSai.Sciが応着されているよ

さらに、リング中心を選つてY軸に沿う線上に

び3輪まわりのモーメントが作用した場合の本実 施例の検出動作を、上記第4図(a)〜(f)および以下 に示す第5図〜第9図を参照しながら説明する。

(1) カドェの検出動作

荷重伝達部10.15間に第5図に示す矢印向きの力ドェが作用すると、薄板17の全間に亘つて第5 図に示すような変形が生じる。なお、第5 図と明じ断面を示す。このような変形にはそののような変形にはそのがしたが、これらストレンゲーシを出ていたが、カドュに比例にある。といてきる。といてはなったなが、カドュに比例は手を得るため、カドュに比例は手を得るため、カドュに比例は手を得るため、カドュに比例は手を得るため、ないできる。とかではないが、がははないが、がいばいによりなが、がいる。というないではない。の位置について第6 図により、(a)、(c)によりが表して、15回によりでは、15回によりには、15回には、

第6図(4)は第5図の一部拡大断面図、第6図(4)

おいて、ストレンゲージSai. Sazが貼 ちと対向する側にストレンゲージSai. Sazが貼 着されている。ストレンゲージSai. Sazはほぼ 何度伝達部15との境界上に位置し、ストレンゲージSaz. Sazは円柱16との境界近くに位置する。 ストレンゲージSaz. Sazに近接してX触方何両 側にそれぞれストレンゲージSaz. Saa, および ストレンゲージSaz. Saaが貼着されている。こ のように各ストレンゲージが配置された確板17に より環板状荷重検出部が構成される。

社状荷重検出部11の各平行平板構造12.13および環板状荷重検出部の環板17に貼着されたストレンゲージは、それぞれ所定のものどうしの組合せによりホイートストンブリッジ回路を構成する。第4図(4)~(1)はこれらホイートストンブリッジ回路の回路図である。各図で、20は電源、「x・「v・「z・mx , mv , mz は出力信号を示す。なお、各ストレンゲージには第1~3図に示す符号と同一符号が付してある。

次に、荷重伝達部10.15間に3輪方向の力およ

は第6図(a)に示す薄板の各部分の半径方向の応力分布図である。第6図(a)で、の1.5は荷度伝達部15と薄板17との連結部の応力(したがつてストレンゲージSc1の応力)の1.6は円柱16と薄板17との連結部の応力を示す。この場合、応力の1.5は引張り応力(正)、応力の1.6は圧縮応力(負)となり、それらの地対値は次式の関係にある。

1013 | < 1011

このような分布において、薄板17における円柱16に近い側に、ストレンゲージSciの貼着位置に生じる応力とは絶対値が等しく正負が逆である応力

σ = cz(1 σ = cz 1 = σ = cz < 0) を生じる個所が存在する。そこで、当該個所にストレンゲージを貼着すればストレンゲージSciのひずみと組対値が等しく正負が逆であるひずみを生じる。上記のような個所に貼着されるのがストレンゲージSciである。これは、ストレンゲージSeiについても同様である。かくして、第

特開昭63-113328 (4)

- <u>---</u> -

4図向に示す回路から力Pェに比例した信号「ェ を得ることができる。

上記の力ド』が作用したとき、第4図(のに示すまイートストンプリッジ回路以外の回路からは出力が生じない。即ち、まず第4図(ののホイートストンブリッジ回路についてみると、これを構成するストレンゲージは前述の如くストレンゲージを前述の如くストレンゲージを立て貼着されているので、上記の説明から明らかなようにいずれも同一量、同一符号(引張又は圧縮)のひずみを生じる。このため、この回路から出力は生じない。これは第4図(のホイートストンブリッジ回路についても同様である。

次に、第4図(の。(d)に示すホイートストンプリッジ国路についてみる。柱状商重検出部11の平行平板構造12、13に対して、力P。はそれらの各薄肉部の面に沿つて作用する。したがつて、カP。に対して各薄肉部の関性は極めて高く、それら各薄肉部に貼着された各ストレンゲージにはほとんどひずみが発生せず、又、発生したとしても

第4図(Mに示す回路の出力についてみると、モーメントMェによつては薄板17におけるリング中心を適るX 性に沿う部分は、この部分が変形の中立性となつているので変形せず、したがつて、ストレンゲージ Sai, Sai, Cはひずみは生じない。そして、第7図に示す変形から明かなようにストレンゲージ Sai, Sai, Cは同一量、逆符号のひずみが、又、ストレンゲージ Sai, Sai にも上述のように同一量、逆符号のひずみがそれでも上述のように同一量、逆符号のひずみがそれでれ生じるので、第4図(Mに示す回路からの出力はない。

次に、第4図にに示す回路の出力についてみる。この場合、その回路を構成するストレンゲージ San. Sca, San, Scaは上記変形の中立軸から 外れた位置に貼着されており、したがつてひずみを生じる。このひずみをみるため、モーメントMa が作用したときの薄板17におけるストレンゲージ San. Sca, San, Scaの貼着部分の変形について考察する。モーメントMa による第7図に示す 変形において、荷重伝達郎15は充分に開性が大き

それらは同一量、同一符号のひずみとなる。この ため、第4図(の。回、のに示すホイートストンブ リツジ回路から出力は生じない。

このように、力F』が作用したときには、第4 図(のに示すホイートストンブリッジ回路からそれ に比例した信号 「』を得ることができ、他の回路 からの出力はないので、高い精度の検出ができる。

(2) モーメントMェ の検出動作

荷量伝達部10.15間にX軸まわりのモーメントMx が第7回に示す矢印向きに作用した場合を考える。なお、第7回は第2回に示す線W-Wに沿う一部断面回である。この場合、薄板17には回示の変形が生じ、ストレンゲージSxx、Sxx、Sxxには引張りひずみか、又、ストレンゲージSxx、Sxx、Sxxには上記引張りひずみと大きさが等しい圧縮ひずみが生じる。そこで、第4回回に示すようにストレンゲージを選択してホイートストンブリッジ回路を構成すると、モーメントMx に比例した信号mx を得ることができる。

ここで、上記モーメントMェ が作用したときの

いので、同一平面を保持したままの状態にある。このため、上記部分は円柱16と荷重伝達部15との間で僅かな関れ変形を生じる。この関れ変形はストレンゲージSas, Scaの贴着位置が当該機れ変形の中立軸に近接しているので振めて微小ではあるが、それでも、ストレンゲージSas, Scaに微小引張りひずみを、又、ストレンゲージのより、Sas, Scaに微小圧縮ひずみを生じる。そして、モーメントMa に対する対称性からそれらのひずみの絶対値は等しい。

以上のことから、第4図にに示す回路では、ストレンゲージSam. Samが互いに同一量、逆符号のひずみとなり、同じくストレンゲージSam. Same も同一量、逆符号のひずみとなるので、当該回路からの出力はない。

次に、第4図40、(e)、(f)に示す回路の出力についてみる。モーメントM®が作用すると、往状育重検出部11の平行平板構造12の両環内部には、一方に圧縮応力、他方に引張応力が生じるが、これらの応力は薄肉部の面に沿つて生じるので、これ

に対し確内部は高い関性を示す。したがつて、平行平板構造12の薄肉部にはほとんど変形を生じない。そして、仮に変形を生じたとしても、ストレンゲージS・1~S・1・に敵小圧縮ひずみ(又は数小引張りひずみ(又は微小圧縮ひずみ)を生じ、それらの絶対値は等しい。以上のことから、モーノントMェが作用しても第4図(6)。(1)に示すホイートストンブリッジ回路からの出力はない。

又、平行平板構造13についてみると、モーメントMxが作用したとき、その両簿内部は、それらに生じる応力がそれらの面に沿うものであるため、極めて高い剛性を示し、ほとんど変形を生じない。しかも、ストレンゲージSII。 SIII、 SIII、 SIII、 SIII、 SIII の中心軸 (X軸) を遺る垂直線上にあるので、ほとんどひずみを生じることはない。したがつて、第4図(d) に示すホイートストンブリッジ回路からの出力はない。

このように、モーメントMx が作用したときに

ないのは明らかである。そこで、第4図(J)に示す。 回路について考える。

モーメントMv が作用すると、平行平板構造12 の薄肉部にはこれに応じて応力が生じる。しかし、 この応力は当該薄肉部の面に沿うものであるので、 薄肉部の剛性は極めて高く、各ストレンゲージに はほとんどひずみを生じない。特に、ストレンゲ ージ Sai, Szz. Sai, SazはX-Z面上におけ るモーメント中心軸 (Y軸) を通る垂直線上にあ るので、ひずみは0に近い。これに対して、スト レンゲージ S 33, S 34, S 43, S 44 は 前記中心軸 から相当離れた位置に貼着されているので、極く 佐かではあるがひずみを発生する。即ち、前記中 心軸の一方側に引張りひずみ、他方側に圧縮ひず みが生じる。そして、そのひずみの量は、両側の ストレンゲージが前記中心軸から等しい位置に貼 教されているので同一である。これを、第 4 図(I) に示される回路でみると、ストレンゲージSia. Sょまは同一量で逆方向のひずみ、ストレンゲージ Sss.Sょ・も同一量で逆方向のひずみを生じるの は、第4図のに示す水イートストンブリツジ回路 からそれに比例した信号mx を得ることができ、 他の回路からの出力はないので高い精度の検出が できる。

(3) モーメントMェ の検出動作

この場合の検出動作は、モーメントMx が作用 したときの検出動作と同じであるのは明らかであ る。そして、第4 図(のに示すホイートストンプリ ッジ回路から、作用したモーメントMy に比例し た信号my を得ることができる。

ただし、モーメントM。の検出動作においては、モーメントM。が作用したときの平行平板構造12の薄肉部に生じたと同じ応力が平行平板構造13の薄肉部に生じたと同じ応力が平行平板構造12の薄肉部に生じたと同じ応力が平行平板構造12の薄肉部に生じる点で、それら平行平板構造12、13のストレンゲージに数小ひずみが生じるときその数小ひずみに相違がみられる。しかしながら、それらストレンゲージの貼着位置関係から、モーメントM。が作用したとき第4図回。回に示す回路から出力が

で、当該回路の出力はないことになる。

このように、モーメント Mv が作用したときには、第4回のに示すホイートストンブリッジ回路からこれに比例した信号 mv が出力され、他の回路からの出力はないので、高い精度の検出ができる。

(4)カFェの検出動作

高重伝達部10。15間にX執方向の力Pェが第8 図に示す向きに作用した場合を考える。なお、第8図は第2図に示す線IIーIIに沿う一部断面図である。この場合には、平行平板構造13の簿内部にから、第8図に示すように平行平板構造13の簿内部に対ゲージSii. Szzは引張りひずみ、ストレンゲージSiz. Szzは引張りひずみ、ストレンゲージ Siz. Szzは圧縮ひずみを生じ、それらひずみの量は同一である。したがつて、第4図似に示すれてもる。したは号(ェを得ることができる。

ここで、力Pェが作用したときの第4図(m)~(c).

した力Fv に比例した信号 fv を得ることができる。そして、力Fv が作用しても、第4図 (4) ~ (の に示すホイートストンブリッジ 回路からは、力Fx の場合の説明から明らかなようにほとんど出力を生じない。

ただ、力Fvの作用により平行平板構造12の選 肉部に変形を生じると、そこに貼着された各スト レンゲージSai、Sai、Saiにひずみを生 じるばかりでなく、第4図(f)に示す回路を構成す る各ストレンゲージSai、Sai、Sai、Saiにも ひずみを生じる。この場合、ストレンゲージSai、 Saiは圧縮(引張り)ひずみ、ストレンゲージ Sai、Saiは引張り(圧縮)ひずみとなる。しか し、これらひずみの大きさはすべて等しい。した がつて、第4図(f)に示す回路からは出力を生じない。

このうよに、カFv が作用したときには、第4 図(e)に示すホイートストンブリッジ回路からこれ に比例した信号 1v が出力され、他の回路からの 出力はほとんど 0 であるので、高い特度の検出が された第4図にに示すホイートストンブリッジ回路からは信号が出力されることもあるがこの信号 は極めて敬小であり、充分に無視し得る程度のも のである。

このように、カFェが作用したときには、第4 図のに示すホイートストンブリッジ回路からこれ に比例した信号 (x が出力され他の回路からの出 力はほとんど 0 であるので、高い裕度の検出がで きる。

._(5) カFェの検出動作:

この場合の検出動作は、カFxが作用したときの検出動作と同じであり、平行平板構造12の薄肉部に顕著な変形が生じ、この変形に応じて第4回回に示すホイートストンブリッジ回路から、作用

できる.

(6) モーメントM2 の検出動作

荷重伝達部10, 15間にて軸まわりのモーメント M。が第9図に示す向きに作用した場合を考える。 なお、第9図には、理解を容易にするため、平行 平板構造12のみを示し、他は除去してある。モー メントMェ が作用すると、平行平板構造12の薄肉 郎が接合している上下の剛体において、下部の刚 体 (荷重伝達部10個) に対して上部の関体が同軸 を保持したまま回転する監機となるので、各薄肉 郎はモーメントMェ によりその面外荷重を受ける ことになり、図示のように扱れ変形を生じる。こ の変形により、ストレンゲージS;;, Sィィには引 妥りひずみが、又、ストレンゲージSょs. Sょィに は圧縮ひずみが生じ、それらひずみの大きさは等 しい。したがつて、第4図切に示すホイートスト ンプリツジ回路からは、モーメントM1 に比例す る信号のこが出力される。

ここで、モーメントMェが作用したときの第4 図ω~®に示す回路の出力について考察する。モ ーメンドMI は、選板17に対してはそれらの面に 沿う荷重であり、剪断力として作用するので、選 板17には変形を生じることはなく、そこに贴着さ れた各ストレンゲージにはひずみを生じることは ない。したがつて、第4図(4)~(6)に示す回路から の出力はない。

このように、モーメント Mェ が作用したときには、第4 図(のに示すホイートストンプリッジ回路からこれに比例した信号 m₂ が出力され、他の回路からの出力はないので、高い特度の検出ができる。

るストレンゲージS.i. S.i. S.i. S.i. S.i.とは反 対面 (表面) に貼着される。これら内側に貼着さ れるストレンゲージにはダツシエが付されている。

本実施例における各荷重検出動作は、さきの実 施例と同じであるので説明は省略する。又、本実 施例の効果についても、さきの実施例と同じであ る。

なお、上記各実施例におけるストレンゲージの 貼着位置は 1 例を示すものであり、高額度の検出 動作を実行させるための貼着位置はこれに限るこ とはない。

(発明の効果)

以上述べたように、本発明では、第2の荷重伝 連部に連結された角柱状の第1の荷重検出部、およびこの第1の荷重検出部に連結された円柱と第 1の荷重伝連部の間に連結された薄板の第2の荷 重検出部を設け、第1の荷重検出部に、ストレン ゲージのような検出素子を設けた2つの平行平板 構造を構成し、又、第2の荷重検出部の薄板の選 宜個所に検出素子を設けるようにしたので、従来 以上、第1図~第3図に示す本実施例の行重検 出器の検出動作について説明した。本実施例の行重検 重検出器は、作用する6つの荷重成分に対して上 記のように高精度の検出が可能であるが、それば かりではなく、図から明らかなように、第11図に 示す従来の荷重検出器に比較して貫通孔は2つ形 成するだけであり、全体構成が簡素であるので、 加工が極めて容易となる。又、ストレンケージの 貼着面も半波し、貼着作業も容易となる。

第10図は本発明の他の実施例に係る荷重検出器の正面断面図である。図で、第3図に示す部分と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。さきの実施例においていは、薄板17は円柱16における柱状荷重検出部11個の面から延出するように連結されていた。これに対して本実施例では、薄板17、は円柱16における柱状荷重検出部11個と反対の面から延出するように連結されている。又、薄板に貼着されるストレンゲージのうち、内側に貼着されるストレンゲージの。まで Sai, Sei~ Sai, Sei~ Sai, Sei~ Sai, Sei~ Sai, Sei~ Sai, Sei~ Sai,

の荷重検出器に比べて加工、および検出素子の設 置作業を容易に実施することができる。

4. 図面の簡単な説明

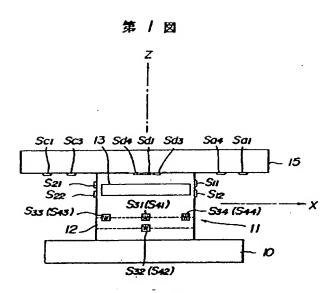
第1図、第2図および第3図はそれぞれ本発明の実施例に係る何重検出器の正面図、平面図および断面図である。第4図(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f) は第1図、第2図および第3図に示すストレンゲージで構成されるホイートストンブリッジ回路の回路図、第5図、第6図(a)、(a)、第7図、第8図、および第9図はそれぞれ第1図に示す何重検出器の動作を説明する変形状態図、第10図は本発明の他の実施例に係る何重検出器の新面図、第11図は代来の荷重検出器の斜視図である。

10.15…荷重伝達部、11…柱状荷重検出部、12.13…平行平板構造、16…円柱、17…薄板。

代理人 弁理士 武 顕次郎 (外1名



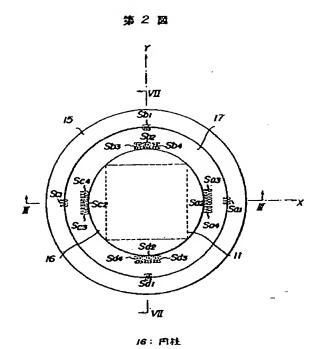
特開昭63-113328 (8)



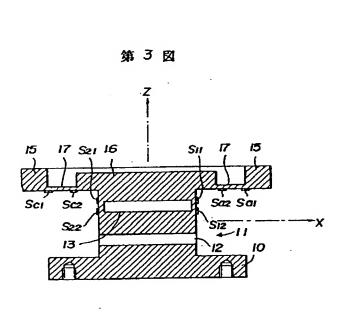
10,15:荷重负重部

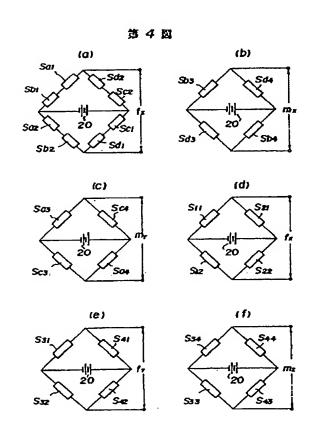
11: 柱状荷生技士部

12,13:平纤华旅港庄



17: 薄板





特開昭63-113328 (9)

